

# MICROSCOPIE À FORCE ATOMIQUE (AFM)

---

FABRICANT : Park Systems

---

MODÈLE : XE-150

---

## Échantillons

- Taille d'échantillons : 150 mm (6 po) maximum
- Épaisseur : 25 mm (1 kg) maximum

## Analyses

- Mode : contact et non-contact
- Principalement utilisé pour la métrologie non-destructive sur échantillons (gravures et lithographie) et caractérisation de la rugosité de couches minces

## Caractéristiques

- Résolution latérale : 1.5 nm (closed-loop), 0.01 nm (open-loop)
- Cartographie possible
- Balayage XY avec système de rétro-action en boucle fermée (closed-loop feedback control)
- Dimension scan XY: 100 x 100  $\mu\text{m}^2$  – Scan vertical: 12  $\mu\text{m}$
- Niveau de bruit du balayage en Z : 0.05 nm (maximum)
- Plateau motorisé avec un déplacement maximal de 225 x 150 mm (résolution: 0.5  $\mu\text{m}$ )
- Acquisition de données programmable en multiple points
- Caméra CCD haute resolution ( MPx) - champ de vision maximum de 1680 x 1260  $\mu\text{m}$
- Table anti-vibration active and chambre acoustique
- Pointes très profilées pour la métrologie de nanostructures avec un rapport d'aspect élevé